

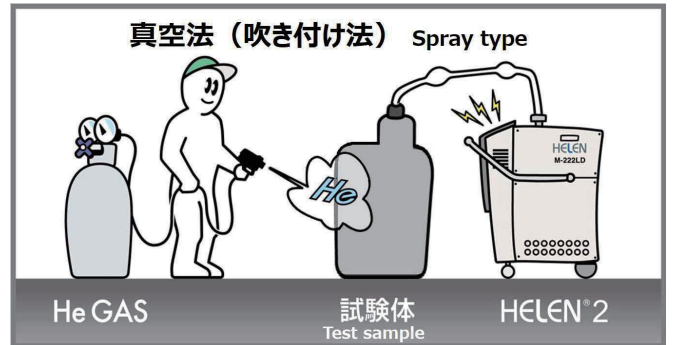


The best selection of leak detectors

漏れ検出のベストセレクション

Helium Leak Detector HELEN series

ヘリウムリークディテクタ HELEN(ヘレン)シリーズ



大型試験体

Large test sample

- ・ 半導体製造装置 · Semiconductor equipment
- ・ 電子部品用真空利用装置 · Electron device equipment



自動車関連部品

Automotive parts

- ・ エンジン系部品
- ラジエーター
- インジェクター
- ・ 燃料系部品
- 燃料タンク
- パイプ

- ・ Engine parts
- Radiator
- Injector
- ・ Fuel system parts
- Fuel tank
- Piping

冷凍空調機器

Air conditioning and Freezing equipment

- ・ エアコン部品
- 熱交換器
- 配管

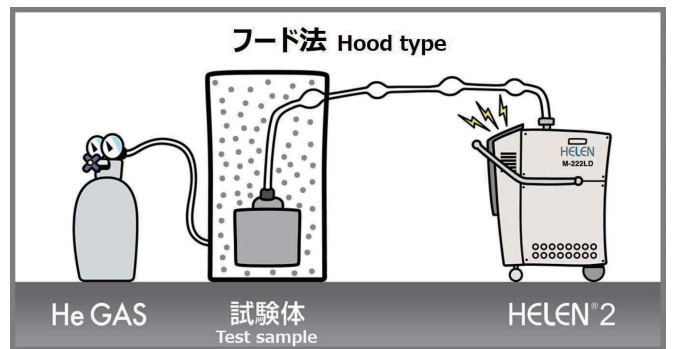
- ・ Air conditioning parts
- Heat exchanger
- piping

その他

Others

- ・ 食品
- ・ 医療機器
- ・ ガス機器
- ・ 各種配管

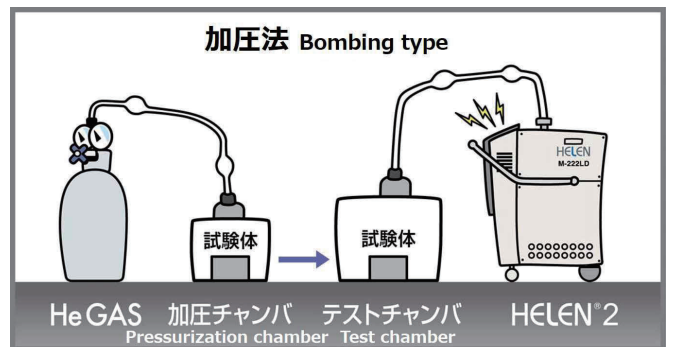
- ・ Food package equipment
- ・ Medical equipment
- ・ Gas system equipment
- ・ Various piping



小型試験体

Small test sample

- ・ 真空部品・真空容器 · Vacuum parts · Vacuum chamber
- ・ 溶接配管・溶接ベローズ · Welding pipe · Welding bellows
- ・ 機密端子等 · Airtight terminal



パッケージ IC

Package IC

水晶振動子

Crystal resonator

SAW フィルター

SAW filter

リレー

Relay

Canon

Visualizing invaluable gases

見えないガスを見る化

Compact Gas Analysis System C Series

コンパクト型ガス分析システム Cシリーズ

残留ガス
測定

Residual
gas analysis

高感度
成膜プロセス
測定

Deposition process
gas analysis

昇温脱離
ガス分析

Thermal desorption
gas analysis

封止ガス
分析

Sealed
gas analysis

触媒反応
ガス分析

Catalysis
gas analysis

炉内ガス
分析

Furnace
gas analysis



この他、様々なガス分析についてご相談ください

Please contact us for various gas analysis

CANON ANELVA CORPORATION



The measurement for quality of the vacuums in real time

真空の“質”をリアルタイムで測定

Quadrupole Mass Spectrometers M-070QA-TDF, M-101QA-TDF, M-101/201QA-TDM

四重極型質量分析計 M-070QA-TDF, M-101QA-TDF, M-101/201QA-TDM



特長 Features

- 真空中におけるガス組成の変化をリアルタイムに測定
Applicable for measuring change of gas composition in real time
- 優れた基本性能（最小検知分圧・広いダイナミックレンジなど）
Excellent basic performance (e.g., Minimum detected partial pressure, wide dynamic range)
- 各種用途に対応するラインアップ^o
Four(4) models for various use
- 最新の専用ソフトウェアQuadvision3 標準添付（Windows7、8.1、10対応※）
Includes dedicated software “Quadvision3” (OS: Windows7, 8.1, 10)

用途 Applications

- 各種真空装置の残留ガス分析とリークチェック
Residual gas analysis and leak check of various vacuum equipment
- 脱離ガス分析
Desorption gas analysis

仕様 Specifications

型名 Model	M-070QA-TDF	M-101QA-TDF	M-101QA-TDM	M-201QA-TDM
測定質量数範囲 (m/z) Measurement range	1~70	1~100	1~100	1~200
動作圧力 Operating Pressure	1.3×10 ⁻² Pa 以下 or less			
ダイナミックレンジ Dynamic range	6桁 Digits	7桁 Digits		
最小検知分圧 Minimum detected partial pressure	6.7×10 ⁻⁹ Pa 以下 or less	5.0×10 ⁻¹⁰ Pa 以下 or less	1.0×10 ⁻¹² Pa 以下 or less	
接続フランジ Connection flange	φ70 ICF			
用途 Application	残留ガス分析 Residual gas analysis			脱離ガス分析 Desorption gas analysis

※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

Windows is registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the united states and/or other countries

CANON ANELVA CORPORATION



Applicable for both PVD Process monitoring and Residual Gas Analysis

スパッタプロセスモニタリングと残留ガス分析の両立

Process Gas Monitor M-080QA-HPM プロセスガスモニタ M-080QA-HPM



スパッタ成膜における製品の 品質管理と装置の不具合解析

Product quality control in sputtering process and trouble analysis of production equipment

スパッタ成膜プロセス中のガスモニタ

Gas monitor for sputtering in-process

残留ガス分析

Residual gas analysis

リークチェック

Leak check

特長 Features

- 差動排気系無しで2Pa以下の圧力で動作可能
Capable of Operation in pressure less than 2Pa without differential pumping system
- プロセス中の水素を高感度で検出
Detecting H₂ with high sensitivity in Sputtering process
- 長いフィラメント寿命で低TCO
Low TCO : Long filament life
- 特別仕様により酸化膜プロセスも対応
Oxidation film sputtering process-response by special specifications

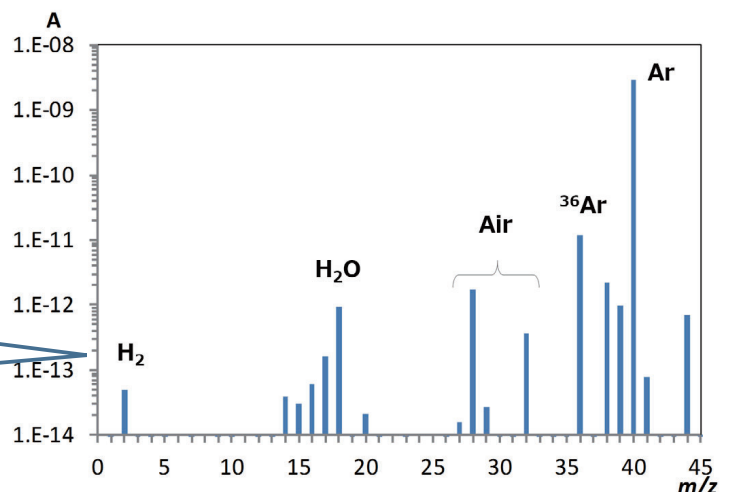
測定例 Measurement example

Ar 0.3Pa導入時のマススペクトル (バックグラウンド処理後)

Mass spectrum example; 0.3Pa of Ar injection
(back-ground data has been processed)

水素を高感度で
検出可能

H₂ partial pressure is detectable
with high sensitivity

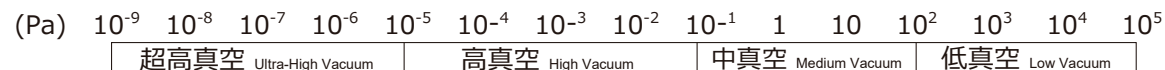




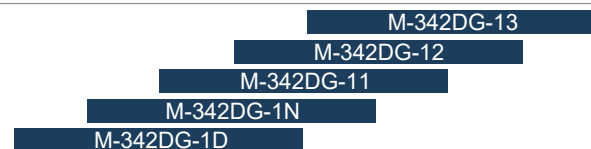
Seamless coverage from atmosphere to ultra-high vacuum

大気から超高真空までもれなくカバー

Transducer Vacuum Gauge Series トランスデューサ型真空計シリーズ



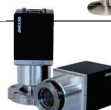
キャパシタンスゲージ M-342DG
 Capacitance Diaphragm Gauge M-342DG
 絶対圧真空計 - 優れたゼロ点安定性
 Excellent zero point stability



ピラニゲージ M-350PG/M-351PG (耐蝕型)
 Pirani Gauge M-350PG / M351PG (corrosion-resistant)
 低~中真空領域測定 - 再現性がよく低価格
 Good repeatability and low cost



コールドカソードゲージ M-370CG
 Cold Cathode Gauge M-370CG
 1Pa ~ 超高真空まで測定 - フィラメントがなく堅牢
 Good startability under high vacuum



コールドカソードピラニゲージ M-361CP
 Cold Cathode Pirani Gauge M-361CP
 大気圧~超高真空まで測定 - 1台で広い領域を安定測定
 Wide range measurement is realized by just one gauge



イオンゲージ M-311HG
 Ion Gauge M-311HG
 超高真空領域まで測定 - 優れた再現性
 Wide pressure measurement range



クリスタルイオンゲージ M-336MX
 Crystal Ion Gauge M-336MX
 大気圧~超高真空まで測定 - 優れた再現性
 High precision with excellent repeatability in the low vacuum range

